

**Ricardo Aparecido Rodrigues de Oliveira**Endereço para acessar este CV: <https://lattes.cnpq.br/8696777785520555>

Última atualização do currículo em 23/02/2023

Resumo informado pelo autor

Ricardo A. R. de Oliveira possui formação em nível superior e também técnica que o habilita em áreas correlatas a tecnologia fina - microeletrônica; a indústria - projetos de automação industrial e, também, na área de treinamento em empresas e em instituições de ensino - possuindo experiência com ensino em nível técnico e superior, nas áreas de tecnologia e engenharia e como consultor e palestrante na área de segurança em eletricidade - NR10. Graduado em 2000 em tecnologia de Materiais Processos e Componentes Eletrônicos pela Faculdade de Tecnologia de São Paulo - UNESP. Realizou programa de mestrado em Engenharia Elétrica na Escola Politécnica da Universidade de São Paulo onde adquiriu experiência na área de Engenharia Elétrica, com ênfase em Materiais e Componentes Semicondutores, atuando principalmente nos seguintes temas: PECVD, microeletrônica, filmes finos, plasma processing e photoluminescence. É professor nas áreas de tecnologia e engenharia elétrica e de automação, tendo atuado em instituições como o SENAI, UNINOVE, ANHANGUERA e CEETPS, ministrando aulas em eletricidade e eletrônica, bem como automação e mecatrônica. Atualmente é professor no IFSP, na área de automação nos cursos em nível técnico e de graduação e concluiu o doutoramento em Engenharia elétrica na área de MEMS - Sistemas Microeletromecânicos e novos materiais aplicados a tecnologia de microdispositivos na Escola Politécnica da Universidade de São Paulo.

(Texto informado pelo autor)**Nome civil****Nome** Ricardo Aparecido Rodrigues de Oliveira**Dados pessoais****Nascimento** 02/08/1976 - São Paulo/SP - Brasil**CPF** 170.957.108-05**Formação acadêmica/titulação**

- 2016 - 2022** Doutorado em Doutorado em Ciências.
Universidade de São Paulo, USP, São Paulo, Brasil
Título: Desenvolvimento de microaquecedores MEMS, para deposição de filmes finos, pela técnica LPCVD, em áreas micrométricas, Ano de obtenção: 2022
Orientador: Marcelo Nelson Paez Carreno 
- 2000 - 2003** Mestrado em Engenharia Elétrica.
Universidade de São Paulo, USP, São Paulo, Brasil
Título: Estudo e Produção de Ligas Amorfas Hidrogenadas de Silício, Oxigênio e Nitrogênio, ricas em silício (a-SiOxNy:H), obtidas por PECVD, Ano de obtenção: 2003
Orientador: Prof PhD. Inés Pereyra Alvarez
Bolsista do(a): Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior
- 2004 - 2004** Especialização em Programa Especial de Formação Pedagógica.
Universidade Metodista de Piracicaba, UNIMEP, Piracicaba, Brasil
Título: Estágio Supervisionado
- 1996 - 2000** Graduação em Materiais Processos e Componentes Eletrônicos.
Faculdade de Tecnologia de São Paulo, FATEC, Brasil

Formação complementar

- 2009 - 2009** Curso de curta duração em Programação C para Microcontroladores 8051. (Carga horária: 24h).
Microgenios, MICROGENIOS, Brasil
- 2008 - 2008** Curso de curta duração em Reles para aplicação Industrial. (Carga horária: 8h).
FINDER, FINDER, Brasil
- 2007 - 2007** Curso de curta duração em Microcontrolador 8051. (Carga horária: 60h).
SENAI - Departamento Regional de São Paulo, SENAI/DR/SP, São Paulo, Brasil
- 2007 - 2007** Curso de curta duração em Proteus VSM. (Carga horária: 14h).
ANACOM ELETRONICA LTDA, ANACOM, São Caetano Do Sul, Brasil
- 2007 - 2007** Curso de curta duração em Automação com Controladores Lógicos Programáveis. (Carga horária: 40h).
FESTO, FESTO, Brasil
- 2006 - 2006** Curso de curta duração em CLP Linguagem de Programação, segundo a IEC 6 1131. (Carga horária: 45h).
SENAI - Departamento Regional de São Paulo, SENAI/DR/SP, São Paulo, Brasil
- 2005 - 2005** Curso de curta duração em Segurança em Instalações e Serv. em Eletricidade. (Carga horária: 40h).
SENAI - Departamento Regional de São Paulo, SENAI/DR/SP, São Paulo, Brasil
- 2002 - 2002** Curso de curta duração em Preparação de docentes terceirizados. (Carga horária: 21h).
SENAI - Departamento Regional de São Paulo, SENAI/DR/SP, São Paulo, Brasil

Atuação profissional

1. Instituto Federal de São Paulo - IFSP

**Vínculo
institucional**

2014 - Atual Vínculo: Servidor público , Enquadramento funcional: Professor em regime RDE , Carga horária: 40, Regime: Integral

2013 - 2014 Enquadramento funcional: Professor , Carga horária: 20, Regime: Parcial

2. Universidade Anhanguera de São Paulo - UNIAN/SP

**Vínculo
institucional**

2013 - 2014 Vínculo: Funcionário , Enquadramento funcional: Professor do Ensino Superior , Carga horária: 10, Regime: Parcial

3. Universidade Nove de Julho - UNINOVE

**Vínculo
institucional**

2009 - 2013 Vínculo: Funcionário , Enquadramento funcional: Professor do Ensino Superior , Carga horária: 35, Regime: Parcial
Outras informações:
Professor nas área de Tecnologia e Engenharia.

4. Escola SENAI "Roberto Simonsen" - senai101

**Vínculo
institucional**

2003 - 2009 Vínculo: Funcionário , Enquadramento funcional: Professor do Ensino técnico , Carga horária: 40, Regime: Integral

5. Laboratório de Microeletrônica da Escola Politécnica da Usp - LME-EPUSP

**Vínculo
institucional**

2016 - Atual Vínculo: Colaborador , Enquadramento funcional: Doutorando em Engenharia Elétrica , Carga horária: 40, Regime: Integral

2000 - 2002 Vínculo: Bolsista de Mestrado , Enquadramento funcional: Mestrando em Engenharia Elétrica , Carga horária: 40, Regime: Dedicação exclusiva

1997 - 2000 Vínculo: Bolsista de I.C. , Enquadramento funcional: Estagiário de Iniciação Científica , Carga horária: 20, Regime: Parcial

Atividades

09/2000 - Atual Pesquisa e Desenvolvimento, Universidade de São Paulo, Departamento de Engenharia de Sistemas Eletrônicos

*Linhas de pesquisa:
Grafeno e MEMS*

08/1997 - 07/2000 Pesquisa e Desenvolvimento, Universidade de São Paulo, Departamento de Engenharia de Sistemas Eletrônicos

*Linhas de pesquisa:
Caracterização elétrica de filmes finos de Carbeto de Silício, obtidos por PECVD*

07/1997 - 07/2000 Estágio, Universidade de São Paulo, Departamento de Engenharia de Sistemas Eletrônicos

*Estágio:
Pesquisa com filmes finos de Carbeto de Silício, obtidos por PECVD*

6. Age Engenharia Ltda - AGE

**Vínculo
institucional**

1999 - 2000 Vínculo: Estágio Remunerado , Enquadramento funcional: Estagiário em Eng.Projetos Elétricos , Carga horária: 20, Regime: Parcial

Atividades

09/1999 - 08/2000 Estágio

*Estágio:
Projetos Elétricos de automação industrial, com comandos eletroeletrônicos e CLP*

7. Bekum do Brasil - BEKUM

**Vínculo
institucional**

1995 - 1996 Vínculo: Funcionário , Enquadramento funcional: Eletricista de painéis eletroeletrônicos , Carga horária: 44, Regime: Integral

1995 - 1995 Vínculo: Funcionário , Enquadramento funcional: Eletricista de Painéis Eletroeletrônicos , Carga horária: 44, Regime: Integral

Atividades

10/1995 - 01/1996 Serviço Técnico Especializado

*Especificação:
Execução e montagem de painéis eletroeletrônicos*

02/1995 - 05/1995 Serviço Técnico Especializado

*Especificação:
Execução e montagem de painéis eletroeletrônicos*

8. Grupo Billi Farmacêutica - BILLI

Vínculo institucional

1991 - 1994 Vínculo: Estagiário , Enquadramento funcional: Estagiário em Eletricidade de Manutenção , Carga horária: 44, Regime: Integral

Atividades

11/1991 - 07/1994 Serviço Técnico Especializado

*Especificação:
Aprendizagem de serviços correlatos a manutenção de equipamentos elétricos e de execução de projetos elétricos*

Linhas de pesquisa

1. Caracterização elétrica de filmes finos de Carbetto de Silício, obtidos por PECVD
2. Grafeno e MEMS

Objetivos:Desenvolver microdispositivo para obtenção de Grafeno pelo método de CVD catalítico

Produção

Produção bibliográfica

Artigos completos publicados em periódicos

1.  PEREYRA, INÉS; CARREÑO, MARCELO N. P.; OLIVEIRA, RICARDO A.R. Validation of MEMS Based New MicroLPCVD Technique for Thin Films Deposition. JICS. JOURNAL OF INTEGRATED CIRCUITS AND SYSTEMS (ED. PORTUGUÊS). , v.15, p.1 - 5, 2020.
2.  PEREYRA, I.; FANTINI, M.C.A.; ALAYO, M.I.; OLIVEIRA, R.A.R.; RIBEIRO, M.; SCOPEL, W.L. Evidence of clusters size-dependent photoluminescence on silicon-rich silicon oxynitride films. Materials Science and Engineering B-Advanced Functional Solid-State Materials. , v.112, p.116 - 119, 2004.
3.  OLIVEIRA, R. Silicon clusters in PECVD silicon-rich SiOxNy. MATERIALS CHARACTERIZATION. , v.50, p.161 - 166, 2003.

Trabalhos publicados em anais de eventos (completo)

1.  OLIVEIRA, R.A.R.; PURIFICACAO, D. D.; PEREYRA, I.; CARRENO, M.N.P. Characterization of silicon thin films obtained by MicroHeater MEMS based-microLPCVD technique In: 2022 36th Symposium on Microelectronics Technology (SBMICRO), 2022, Porto Alegre. 2022 36th Symposium on Microelectronics Technology (SBMICRO). IEEE, 2022. p.1 -
2.  OLIVEIRA, R.A.R.; PEREYRA, I.; CARRENO, M.N.P. Development of MEMS based microCVD technique for new materials thin films deposition In: 2019 34th Symposium on Microelectronics Technology and Devices (SBMicro), 2019, Sao Paulo. 2019 34th Symposium on Microelectronics Technology and Devices (SBMicro). , 2019. p.1 -

Produção técnica

Trabalhos técnicos

1. OLIVEIRA, R. A. R. "Dopagem tipo N de filmes de Carbetto de Silício (a-SiC:H) obtidos por PECVD". R. A. R. Oliveira, M. N. P. Carreño, 8º Simpósio Internacional de Iniciação Científica da Universidade de São Paulo - (2000). , 2000

Página gerada pelo sistema Currículo Lattes em 23/02/2023 às 20:11:28.